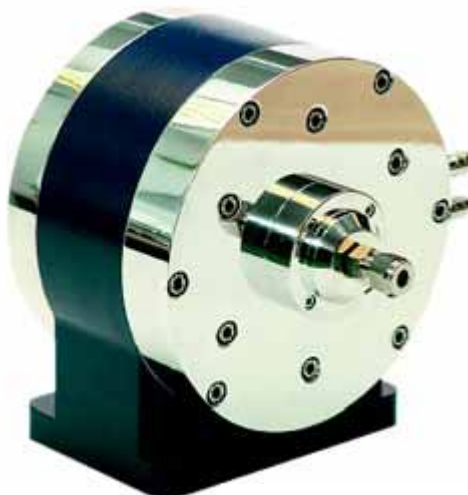


## プラズマ源



MDS Series  
Downstream Source

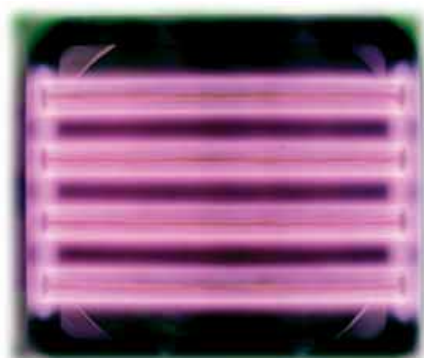
### 仕様 -

型式	MDS20	MDS30	MDS50
プラズマ出力(直径)	20mm	30mm	50mm
真空孔	DN20KF/DN20CF	DN32KF/DN32CF	DN50KF/DN50CF
MW タイプコネクタ	IEC UDR26-M6	IEC UDR26-M6	IEC UDR26-M6
ガス注入口	Swagelok, VCR		
ガスフロー	最大 1000sccm		
処理圧力	20Pa ~ 5000Pa		
MW タイプ電源	最大 2kW	最大 3kW	
冷却方法	水冷方式、3L/min.		
寸法	160mm(直径) × 110mm	160mm(直径) × 103mm	160mm(直径) × 90mm
材質	アルミニウム		
重さ	8kg 以下		
オプション	低圧力応用可能		

## モジュラー プラズマ システム



Modular Plasma System



### 特長

- プラズマアレイ動作範囲 180mm 角
- プロセスチェンバー付き
- ガス注入システム
- チェック機能付き
- 最上部に窓付き
- 床板付き
- 基板ホルダー付き

### オプション

- プラズマモジュール装置追加可能
- 二重電源
- 圧力計
- ガスフローコントローラ
- ポンプユニット
- 真空コンポーネント
- 可動式基板ホルダー

### - 仕様 -

外形寸法	430mm(高さ) × 350mm(奥行き)	重さ	約 40kg
内形寸法	400mm(高さ) × 300mm(奥行き)	ベース圧力	< 1Pa
材質	アルミニウム	処理圧力	10 ~ 500Pa
		マイクロ波電源	最大 3kW × 2

## プラズマ システム



Plasma System M450



### 特長

- コンパクト設計
- 高速に、均一に、広範囲にプラズマを発生
- 均一に、広範囲にガスを注入
- 排気ガスが均一に分布
- 前方にローダ装備

### オプション

- システムサイズをカスタマイズ可能
- 処理システム
- プラズマ検出器
- プラズマモニタ
- インラインシステム

### - 仕様 -

高周波電力	2kW × 2
周波数	2.45GHz +/- 10MHz
処理圧力	20Pa ~ 100Pa
到達圧力	< 0.5Pa
冷却方法	水冷方式 (5L/min.20 )
プロセスチャンバ(内形寸法)	幅: 500mm 以下、奥行き: 350mm 以下 高さ: 450mm 以下、重さ: 200kg 以下